**台灣鍍膜科技協會年會暨國科會專題計畫研究成果發表會**

民國111年07月28日修訂

**著作授權同意書**

為推廣國科會優良成果，積極協助產業技術升級，提升我國技術水準，厚植國家經濟發展基礎，並促進產學合作機會，茲同意永久、無償、非專屬授權國科會工程科技推展中心，將本人於中華民國111 年 11 月 4、5 日，

由台灣鍍膜科技協會主辦之台灣鍍膜科技協會年會暨國科會專題計畫研究成果發表會

會中發表之 □ 口頭發表論文 / □ 海報展覽 / □ 專題演講之相關錄音、錄影、照片、投影片、論文摘要、論文全文內容等檔案，予以進行數位典藏。

本授權書所授權之發表內容題目：

計畫編號 (若非國科會計畫可不填寫)：

立同意書人：

連絡電話：

E-mail：

中華民國 年 月 日